HPGP™-101-C

High Pressure Gas Probe with PDS-E

Provides reliable in-line contamination monitoring for process gases at line pressure.

Without measurement there is no control

ハイテク製造プロセスには、純度の高いガスが必要です。高圧ガスプローブシステムHPGP-101-Cは、ライン圧でのプロセスガスに対する信頼できるインライン汚染物質監視を提供します。

HPGPは、ほとんどの非毒性ガスに対応し、多数の反応性ガス監視アプリケーションで使用できます。

PDS-E (パーティクルデータシステム - イーサネット)は、HPGP-101-Cプローブによって取得されたデータを収集してレポートします。

利点

低コスト

- プロセスガス供給システムの認定を迅速化
- 歩留まりに影響が出る前にガスに含まれるパーティクルを検出
- 酸素、水素など、ほとんどの非毒性ガスに対応

プロセス制御の改善

- ガスの品質を確認
- プロセス異常を検出
- システム変更の影響を数量化
- 正確なパーティクルサイジング
- Facility Netデータ管理ソフトウェアによる包括的なデータ格納、管理、レポート、およびアラーム

信頼性

- パッシブキャビティ設計によりメンテナンスの必要性を軽減
- 不活性ガスパージにより安全性を確保
- サンプルガスが容器に漏れると電子機器の電源を切断

特長

- 0.1 SCFMで0.1 µmの感度
- パーティクルチャネル×8
- 40～150 psigのライン圧
- パッシブレーザーキャビティ
- 並列処理アレイ検出システム
- 安全な格納容器
- 酸素および水素に対応
- CEおよびRoHS 2に準拠

用途

- ガス供給システムの認定
- プロセスガスの監視
- 反応性ガスの監視

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

HPGP™-101-C

High Pressure Gas Probe with PDS-E

仕様

HPGP-101-C

サイズチャネル	スレッショルドが0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 µmの8チャネル
流量	0.1 SCFM (2.8 LPM)
サンプリングレート	0.1 SCFM (2.8 LPM)
計数効率*	0.14 µmで50%を上回る
ゼロカウントレベル	2/立方フィートまたは0.2/分未満
最高濃度**	3,000/立方フィート
光学設計	並列処理アレイ検出器を備えたパッシブキャビティ
光学系	2πステラジアンより大きい立体角での90°広角散乱光集光光学系
レーザータイプ	ヘリウムネオン
データシステム	PDS-E
キャリブレーション	使用するキャリブレーション材質は米国標準技術局(NIST：National Institute for Standards and Technology)に準拠したトレーサビリティを有します。
電源	100、115、220〜230 Vまたは230〜240 V、50〜60 Hz、0.5 A
環境	温度：0〜45 ℃ (32〜113 ° F)、湿度：結露なし、最大高度：3,000 m (9,842フィート)
寸法(奥行き、幅、高さ)	66 x 20 x 22 cm (26 x 8 x 9 インチ)
重量	20.4 kg (45 ポンド)
に準拠	CE, RoHS 2

PDS-E

センサー数	1
サンプリング間隔	1秒〜8:00:00 (hh:mm:ss)
データ管理および分析	Facility Netソフトウェア
コンピューターインターフェイス	RS-232、双方向、イーサネット(PMSプロトコル、Modbus、またはOPCを経由)
電源	100〜240 VAC、50〜60 Hz、0.63 A
環境	温度：0〜45 ℃ (32〜113 ° F)、湿度：結露なし、最大高度：3,000 m (9,842フィート)
寸法(奥行き、幅、高さ)	18 x 22 x 32 cm (7 x 8.5 x 12.5インチ)
重量	5.2 kg (11.5ポンド)

*サンプル流量の許容変動幅は±5%。
**最大推奨環境濃度で精度90%を上回る(計数損失10%未満)。
特許の適用：米国 - 4,798,465、4,893,928、および4,594,715。
日本 - 2,786,187および2,554,614。
ドイツ - 3,712,665C2、3,930,642、および3,485,749.4。
カナダ - 1,228,148。英国 - EP142815。
記載されている仕様は予告なく変更するる場合があります。

All trademarks are the property of their respective owners. Particle Measuring Systems, Inc. reserves the right to change specifications without notice. © 2020 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

PMS Japan

PMS日本支社
(スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F
Tel: 044 589 3498
Fax: 044 245 5000
Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)
Tel: 044 589 3418
Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com

www.pmeasuring.com/jp/